

# FE-SEM: 電界放射型走査電子顕微鏡 (Field Emission Scanning Electron Microscope)

## 原理

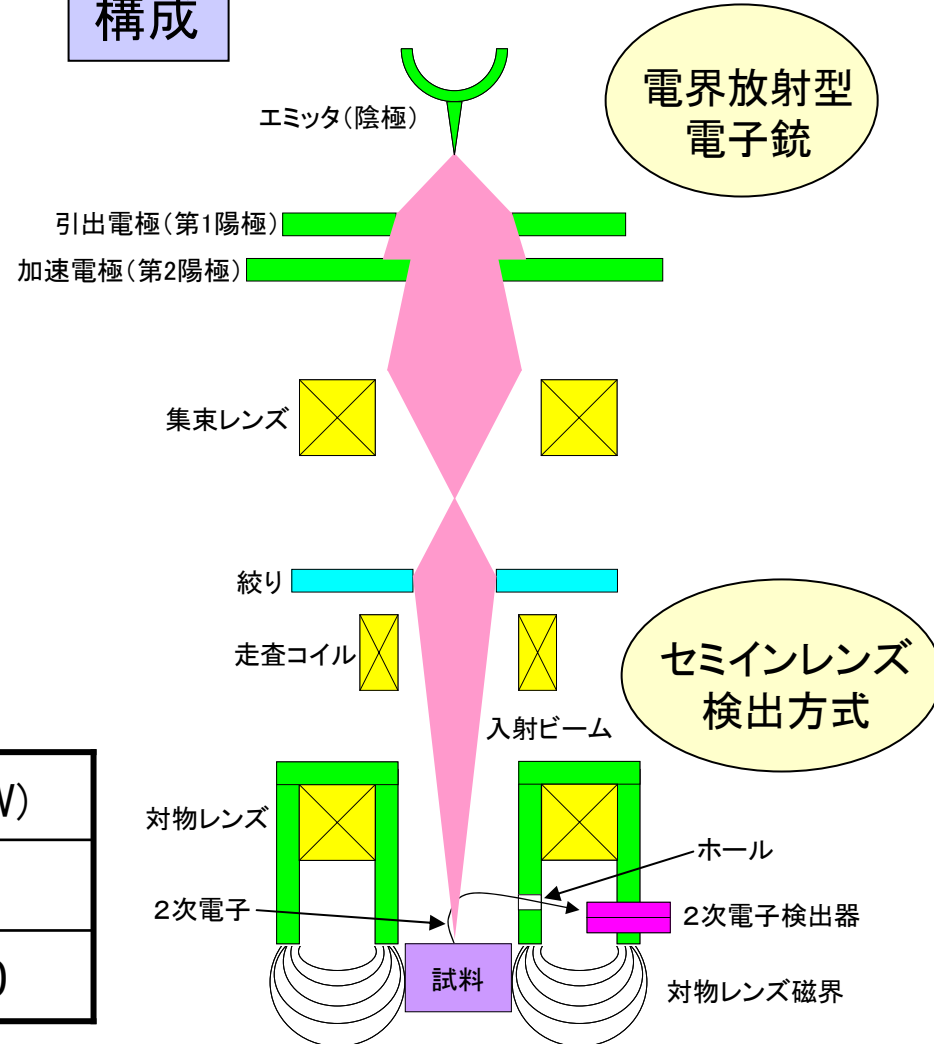
細く絞った電子線で、試料表面を走査することにより、発生した二次電子および反射電子を検出

## 用途

- ・表面形状の高分解能観察
- ・組成像観察

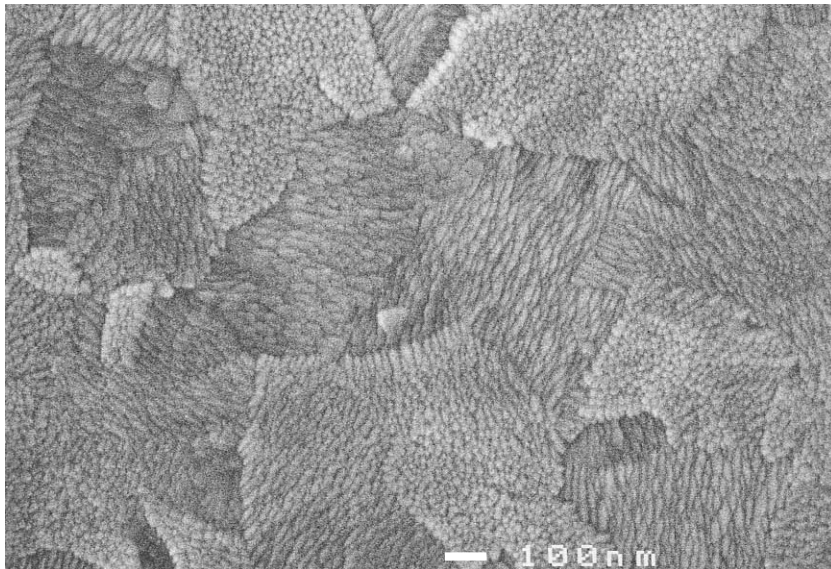
二次電子分解能	1.2nm(加速電圧15kV)
加速電圧	0.5~30kV
観察倍率	×25~×650,000

## 構成

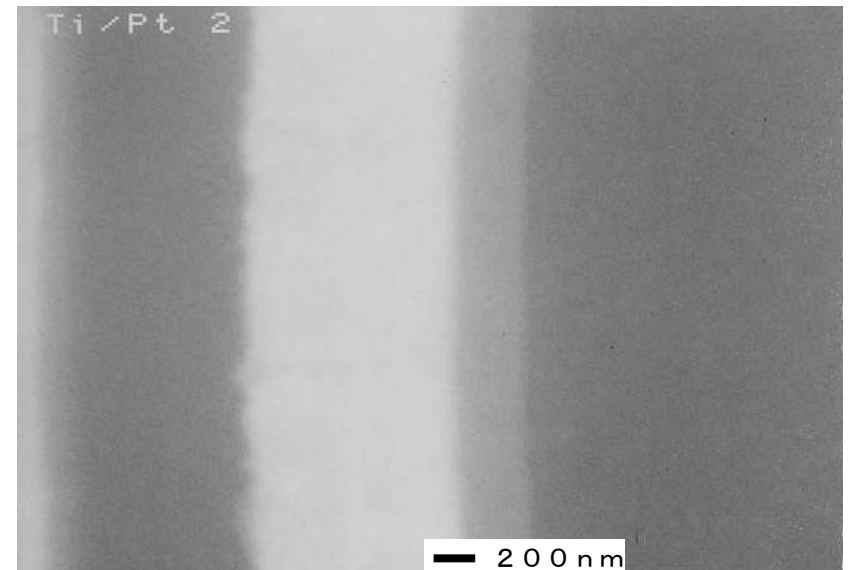


# FE-SEM分析事例

ITOスパッタ膜の表面



Ti/Pt薄膜の断面



表面保護膜

Pt

Ti

基板